

# 超高真空用 脱ガス処理装置

Vacuum - Baking System

## 特長

Features

(例：アルミニウム合金製の場合)

- 全自動。
- 軽量にて基礎工事不要。
- SUS製の1/3の重量。
- 消費電力は従来の1/4。
- 冷却用の水冷パイプ不要。
- 全アルミニウム合金製にて、フランジはICF規格品。
- 内部ヒーターにより、内部は700℃でも容器温度は40℃前後。

( Example: Aluminum alloy )

- Fully automatic.
- Light-weight design, no need of foundation.
- The weight is 1/3 that of stainless steel apparatus.
- Power consumption is 1/4 that of existing apparatus.
- No need of water cooling pipe for cooling.
- The apparatus is made of aluminum alloy and uses ICF standard flanges.
- An internal heater keep the container temperature at about 40℃ ; even at an internal temperature of 700℃ .



## 仕様

Specifications

ワーク最大寸法 Work piece maximum dimensions	325 <sup>W</sup> × 325 <sup>H</sup> × 250 <sup>D</sup> mm
加熱温度 Heating temperature	MAX. 700
到達真空度 Ultimate Vacuum Pressure	2.6 × 10 <sup>-7</sup> Pa (2 × 10 <sup>-9</sup> Torr)
主排気ポンプ Main exhaust pump	ターボ分子ポンプ Turbomolecular pump
電源 Power source	単相 200V 30A 200 V single phase, 30 A
ヒーター Heater	背面、側面2系統 2 systems at rear view and side faces
冷却 Cooling	空冷 Air cooling

お客様の仕様に応じて設計、製作致します。

A custom manufactured apparatus is available based on customer specifications.

A1

真空用ミニコンピュータ

A2

真空フランジ

A3

真空用ボルト・ナット

A4

真空装置

A5

その他アクセサリ

B

分析機器

C

受託業務

D

加速器・放射光利用機器

E

オーダーメイド製品